

Microwave barrier transceiver Soliwave FDR57

Transceiver for non-contact point level detection and bulk flow monitoring



詳細情報と現在の価格は以下をご覧ください:

www.jp.endress.com/FDR57

利点:

- Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
- Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
- Mechanically compatible to FQR50/FDR50 and FQR56/FDR56 microwave barrier, existing process connections can be used; likewise, accessories such as adapter flanges, installation brackets and sight glasses can be used again
- Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
- Measuring principle almost independent of the process properties
- Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
- Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs

仕様一覧

- **プロセス温度** 非接触設置：任意 設備内：-40～+70 °C (-40～+158 °F) 高温アダプタ使用時：最大+450 °C (+842 °F)
- **プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット** 非接触設置：任意 設備内：50～680 kPa (7.2～99 psi) 絶対圧 高压アダプタ使用時：最大+2.1 MPa (+305 psi) 絶対圧
- **最小密度** 粉体質量：> 10 g/l

アプリケーション: The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and

material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.

機能と仕様

リミットスイッチ / 粉体

測定原理

マイクロ波バリア

特性 / アプリケーション

トランシーバ

非接触式レベルスイッチおよび流量監視

対象物の検知、カウント、測位

物質移動ポイントの監視

沈着物や汚染の検知および分析

設置：

非接触設置（伝送窓）またはフロントフラッシュ設置（接触式）

特徴

オプションのバルク流量監視機能

並列モードは最大5チャンネル

検知範囲の上限：最大100 m

流量の検知範囲：最大10 m（粉体に応じて異なる）

電源 / 通信

コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由

周囲温度

-40～+70 °C

(-40～+158 °F)

リミットスイッチ / 粉体**プロセス温度**

非接触設置：任意

設備内：

-40～+70 °C

(-40～+158 °F)

高温アダプタ使用時：

最大+450 °C (+842 °F)

プロセス圧力 (絶対圧力) / 最大過圧リミット

非接触設置：任意

設備内：

50～680 kPa

(7.2～99 psi) 絶対圧

高圧アダプタ使用時：

最大+2.1 MPa (+305 psi) 絶対圧

最小密度

粉体質量：> 10 g/l

主要接液部

非接触設置：

接液部なし

設備内：

SUS 316Ti相当、PTFE、またはセラミック

プロセス接続

ネジ：

1-1/2" R、1-1/2" G、1-1/2" NPT

通信

コントロールユニット付きプロセス変換器Nivotester FTR525を経由

規格適合証明書/認証

ATEX、CSA C/US、IEC Ex

設計認証

EN10204-3.1

リミットスイッチ / 粉体

選択項目

点検窓

高温アダプタ

高圧アダプタ

取付ブラケット

FAR50、FAR51、FAR52、FAR53、FAR54、FAR55

コンポーネント

変換器：FQR57

プロセス変換器：FTR525

アプリケーション限界

粉体質量：< 10 g/l

詳細情報 www.jp.endress.com/FDR57